Docket No.: 241124US3/sao

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Akira KAWAI, et al.

SERIAL NUMBER: 10/630,847 GROUP: 1743

FILED: July 31, 2003 EXAMINER: SINES, BRIAN J

FOR: FINE CHANNEL DEVICE, DESKSIZE CHEMICAL PLANT AND FINE

PARTICLE PRODUCING APPARATUS EMPLOYING THEM

REQUEST FOR PRIORITY ACKNOWLEDGMENT

MAIL STOP ISSUE FEE COMMISSIONER FOR PATENTS P.O. BOX 1450 ALEXANDRIA, VA 22313-1450

SIR:

In the matter of the above-identified application we hereby request acknowledgment of the priority papers filed November 14, 2003, as evidenced by the enclosed copies of the date-stamped filing receipt, the Request for Priority and the first 7 pages of the Priority Document(s).

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.

C. Irvin Mcelelland

Registration No. 21,124

Customer Number 22850

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 03/06) Paul J. Killos Registration No. 58,014 OSMM&N File No. <u>241124US3</u>

Dept.: PP

By: CIM/hyc

Serial No. <u>10/630,847</u>

In the matter of the Application of: Akira KAWAI, et al.

For: FINE CHANNEL DEVICE, DESKSIZE CHEMICAL PLANT AND FINE

PARTICLE PRODUCING APPARATUS EMPLOYING THEM

Due I		

The following has been received in the U.S. Patent Office on the date stamped hereon:

■ Request for Priority

■ Priority Doc (2)





IN RE APPLICATION OF: Akira KAWAI, et al.

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

GAU:

1744

SERIAL NO: 10/630,847			EXAMINER:				
FILED:	July 31, 2003						
FOR:		CHANNEL DEVICE, DESKSIZE CHEMICAL PLANT AND FINE PARTICLE PRODUCING RATUS EMPLOYING THEM					
REQUEST FOR PRIORITY							
	ONER FOR PATENTS LA, VIRGINIA 22313						
SIR:							
	fit of the filing date of U.S.s of 35 U.S.C. §120.	S. Application Serial Number	, filed	, is claimed pursuant to the			
☐ Full bene §119(e):	fit of the filing date(s) of	U.S. Provisional Application(s) Application No.	is claimed purs Date File	tuant to the provisions of 35 U.S.C.			
	ts claim any right to priorsions of 35 U.S.C. §119, a		tions to which	they may be entitled pursuant to			
In the matter	of the above-identified ap	plication for patent, notice is her	reby given that	the applicants claim as priority:			
COUNTRY		APPLICATION NUMBER		NTH/DAY/YEAR			
JAPAN JAPAN		2002-225104 2002-365666	_	ust 1, 2002 ember 17, 2002			
	:64b			ŕ			
	ies of the corresponding C abmitted herewith	convention Application(s)					
	e submitted prior to paym	ent of the Final Fee					
	filed in prior application S						
Recei	submitted to the Internation in the certified copies be ownedged as evidenced by	onal Bureau in PCT Application by the International Bureau in a t the attached PCT/IB/304.	Number timely manner	under PCT Rule 17.1(a) has been			
☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and							
□ (B) A	application Serial No.(s)						
	are submitted herewith						
	will be submitted prior to	payment of the Final Fee					
			Respectfully S	ubmitted,			
				/AK, McCLELLAND, USTADT, P.C.			
			C. Irvin McCle	elland			
Customer Number			Registration No. 21,124				
2285	50						
Tel. (703) 413-; Fax. (703) 413- (OSMMN 05/0	3000 2220			COP			

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年 8月 1日

出 願 番 号 Application Number:

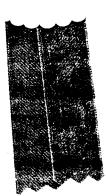
特願2002-225104

[ST. 10/C]:

[] P 2 0 0 2 - 2 2 5 1 0 4]

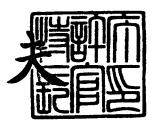
願 人
oplicant(s):

東ソー株式会社



特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年 7月25日

今井康





【書類名】

特許願

【整理番号】

PA211-0831

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

B01J 19/00

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県大和市深見3409-1

【氏名】

片山 晃治

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県相模原市旭町23-4-206

【氏名】

川井 明

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町1689-1-306

【氏名】

二見達

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県相模原市相模大野7-37-17-504

【氏名】

大川 朋裕

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県座間市入谷5-2598-3-701

【氏名】

及川 智之

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県茅ヶ崎市香川333-1

【氏名】

原 克幸

【特許出願人】

【識別番号】

000003300

【氏名又は名称】

東ソー株式会社

【代表者】

土屋 隆

【電話番号】

(03) 5427-5134



【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003610

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】明細書

【発明の名称】微小流路構造体

【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも1種類の流体を導入し、前記流体を化学処理するあるいは前記流体より液滴を生成させるための微小流路を有した構造体において、当該構造体は、流体を導入するための貫通穴と前記微小流路を有した構造体へ流体を供給するための貫通穴を有しかつ前記流体を一次的に蓄える貯蔵空間及び当該貯蔵空間から放射状に直線及び/又は曲線により供給流路が形成された複数の供給用構造体を備え、さらに前記供給用構造体の少なくとも1つには前記微小流路を有した構造体より流体を排出するための貫通穴を有することを特徴とする微小流路構造体。

【請求項2】供給用構造体に貯蔵空間が2つ以上設けられ、当該貯蔵空間より 微小流路を有した構造体の流体導入口へ流体を個別に導入できるよう連結されて なることを特徴とする請求項1に記載の微小流路構造体。

【請求項3】複数の貯蔵空間からの排出口より微小流路を有した構造体へ連結するための流路がそれぞれ重ならずに配置されていることを特徴とする請求項2に記載の微小流路構造体。

【請求項4】流体を化学処理するあるいは流体より液滴を生成させるための微小流路が1以上の基板で構成され、前記微小流路を有した構造体が複数重ね合わされて構成され、かつ前記微小流路の各導入口が複数の貯蔵空間からの供給流路のいずれかに貫通していることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の微小流路構造体。

【請求項5】請求項1~4のいずれかに記載の貯蔵空間が円筒形状であることを特徴とする微小流路構造体

【請求項6】請求項1~4のいずれかに記載の貯蔵空間が多角柱状のくぼみであることを特徴とする微小流路構造体

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年12月17日

出願番号 Application Number:

人

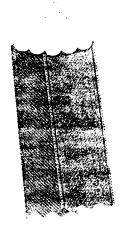
特願2002-365666

[ST. 10/C]:

[JP2002-365666]

顧 Applicant(s):

東ソー株式会社



特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年 7月25日

今井康





ページ: 1/E

【書類名】

特許願

【整理番号】

PA211-0931

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

B01J 19/00

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県相模原市旭町23-4-206

【氏名】

川井 明

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県鎌倉市常盤422-6-315

【氏名】

松本 進一

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県大和市深見3409-1

【氏名】

片山 晃治

【特許出願人】

【識別番号】

000003300

【氏名又は名称】 東ソー株式会社

【代表者】

土屋 隆

【電話番号】

(03)5427-5134

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

003610

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

唐類名】明細書

Was a see need to be a

発明の名称】微粒子製造装置及びこれを利用した微粒子の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】微粒子を製造するための装置であって、当該装置は微小流路を有する微小流路基板を複数枚積層してなる微小流路構造体を複数有し、前記微小流路構造体に1以上の微粒子製造用の流体を供給するための手段と、前記微小流路構造体で生成された微粒子を回収するための手段と、を備えたことを特徴とする微粒子製造装置。

【請求項2】微粒子製造用の流体が液体であることを特徴とする請求項1に記載の微粒子製造装置。

【請求項3】微粒子製造用の流体がゲル製造用原料を含む液体及びゲル製造用 分散剤を含む液体であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の微粒子 製造装置。

【請求項4】微粒子製造用の流体を供給するための手段が圧送方式によるものであり、かつ前記微小流路構造体に供給する液体の脱気する手段を備えたことを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の微粒子製造装置。

【請求項5】微小流路構造体へ流体を供給するための分配器と、微小流路構造体で生成された微粒子を回収するための集約器と、を備えたことを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の微粒子製造装置。

【請求項6】微粒子製造用の流体を供給するための手段として微小流路構造体に予めゲル製造用分散剤を含む液体を一時的に供給する手段を備え、前記微小流路構造体を構成する微小流路内をゲル製造用分散剤を含む液体で満たすことを特徴とする請求項3~5のいずれかに記載の微粒子製造装置。

【請求項7】微小流路構造体に液体を供給する際に、前記微小流路構造体内に 生じる排圧を調整するための手段を備えたことを特徴とする請求項1~6のいず れかに記載の微粒子製造装置。

【請求項8】微小流路構造体を洗浄するための手段を備え、その洗浄手段が微 粒子製造用の流体が送液される方向に対して順方向又は逆方向に液体を洗浄でき る機構を有していることを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載の微粒子製